

2020 年度 日本顕微鏡学会 SEM の物理学分科会研究会

日 時：2020 年 11 月 13 日（金）13:30～16:20

場 所：オンライン開催（Microsoft Teams）

参加費：無料

趣旨：走査電子顕微鏡(SEM)がもたらす多様な像情報を理解するため、本分科会では試料内での電子散乱の物理に加え、装置も含めた「SEM の物理」の議論をすすめてきたが、昨今、コロナ禍により議論を交わす機会が著しく減少している。そこで今年度はオンライン形式で研究会を開催し、SEM の物理に関する議論を再加速させる場としたい。研究会前半では SEM の像形成原理や、それを応用した材料分析について議論し、後半では SEM の要素・周辺技術の進展についてご講演をいただく。

－プログラム－

1. 13:30-13:35 はじめに
関口 隆史（筑波大学）
2. 13:35-14:05 SEM 像コントラストに及ぼす結晶極性の影響
○桑野 範之（九州大学）
3. 14:05-14:30 低加速電圧 SEM-EDX による材料表面・微小部の像観察と元素分析
○名越 正泰，中村 貴也，北原 保子，佐藤 馨（JFE テクノリサーチ）
- 休憩
4. 14:40-15:05 絶縁体の低真空 SEM 観察／二次電子の振舞いと雰囲気依存性
○田上 就也，関口 隆史（筑波大学）
5. 15:05-15:30 巻線収差補正器による SEM 像における球面収差補正の実証
○中野 朝則（日立製作所），山澤 雄（日立ハイテク）
6. 15:30-15:55 SEM コントラストと機械学習を活用した鉄鋼材料の複合組織解析
○井本 浩史，佐藤 馨，名越 正泰，北原 保子（JFE テクノリサーチ）
7. 15:55-16:15 総合討論
8. 16:15-16:20 おわりに
熊谷 和博（産業技術総合研究所）

[お申込み]

2020年11月10日(火)までに申し込みフォームよりご登録下さい。
フォームへは[こちらをクリック](#)，または右のQRコードよりアクセス下さい。
お申込み頂いたメールアドレス宛に会議案内をお送りいたします。
なお，定員（200名）に達し次第，お申込みを締め切ります。



[おことわり]

Microsoft Teams の設定や使用方法についてのお問い合わせにはお答え致しかねます。
都合によりプログラムが変更となることがあります。ご承知おきください。

[お問合せ]

日本顕微鏡学会 SEM の物理学分科会 代表世話人 熊谷 和博
e-mail: quaz.kumagai@aist.go.jp